

VacuLAB-X 小型实验室用真空等离子设备

产品特征:

- 使用简便
- 处理速度
- 真空度
- 集成的放电发生器
- 过程控制
- 等离子过程可视化
- 测试效果通用



供实验室测试和小批量生产使用的台式真空等离子设备

Tantec的VacuLAB是VacuTEC设备的精简版。VacuLAB可用于小批量的测试，并且用户可控制所有参数。采用VacuLAB测试的结果也可应用到VacuTEC设备中。

VacuLAB是根据VacuTEC设备而专门设计的小型设备，具有体积小，方便携带等特点，既可以在实验室即时完成各种样品的效果测试，也可以用于小批量的生产。

VacuLAB集成profance面板，更加有利于控制和监控参数变化的整个过程。

VacuLAB采用标准的陶瓷绝缘电极，保证了测试效果同样适用于VacuTEC设备。

VacuLAB的仓门是透明的，因此用户可观察到等离子放电处理产品的全过程。

Head Office

Tantec A/S
Industrivej 6
DK-6640 Lunderskov
(+45) 7558 5822

Mail:
sales@tantec.com

Web:
www.tantec.com
www.china-tantec.com (中文)

中国区总代:
昆山市坦钛等离子科技有限公司

Tel:
0512-50333890

Mobile:
13862667395

Mail:
sales@china-tantec.com

特点:

- 使用简便 在实验室中可对各种部件进行测试，连接电源和装置即可。
- 处理速度快 材质不同，处理所需时间不同，一般为10-180s。
- 真空度 处理过程中处理仓中的真空度为1-4mbar。
- 集成的放电发生器 300w的**放电发生器**与设备集成为一体，可通过触摸屏上进行控制。
- 过程控制 通过内置的proface面板和PLC装置，可控制和监控整个处理过程。
- 等离子过程可视化 处理仓门是透明材质制作，可以观察到等离子处理的过程。
- 测试效果通用 测试的效果也适用于VacuTEC

技术规格	VacuLAB等离子处理设备
电源电压和频率	230 VAC 50/60 Hz
输出电压/等离子功率	Max. 400 VP/300 Watt
供应电源	完全集成在设备中
真空度	1-4 mbar
等离子处理时间	根据材质，一般需要10-180s
等离子电极系统	绝缘的陶瓷电极
处理材质	小型部件，如高分子材料、金属及半导体
规格(LXW×H(mm))	600 x 410 x 340
重量(Kg)	36
真空仓规格(L×W×H(mm))	120 x 180 x 55
遵循法规	CE - ROHS - WEEE